



## 8月22日(金)

時間	テーマ / 内容	会場
12:30 ~ 13:00	受付開始	
13:00 ~ 13:10	挨拶とオリエンテーリング 久芳 聡子(日本電子)	
[チュートリアル] 座長: 今野 充(日立ハイテクノロジーズ)		
13:10 ~ 14:20	電子線トモグラフィ法に必要な様々な画像処理 工学院大学 馬場 則男 様	1F 第2会議室
14:20 ~ 14:35	休憩	
[トピックス] 座長: 丸山 秀夫(カネカテクノリサーチ)		
14:35 ~ 15:05	Digital Micrographスクリプティング事始め 名古屋大学 武藤 俊介	
15:05 ~ 15:40	電子線ホログラフィーによる有機多層膜層の可視化の検討 日立ハイテクノロジーズ 佐藤 岳志 様	
15:40 ~ 15:50	休憩	
座長: 太田 耕三(富士ゼロックス)		
15:50 ~ 16:25	イオン液体観察法に基づく高分子ナノ粒子ドラッグデリバリーシステムの設計 愛知学院大学 高橋 知里	
16:25 ~ 17:00	シャドウイング法とSEM観察による結晶性微粒子の分布測定 ライカマイクロシステムズ 長澤 忠広	
17:00 ~ 17:15	今後のスケジュール説明と移動	
17:15 ~ 18:20	休憩&バスタイム	各室・大浴場(2F)
18:20 ~ 20:00	夕食(懇親会) 司会: 元井 泰子(キヤノン)、高橋 知里(愛知学院大) 司会: 乾 光隆(セイコーエプソン)	懇親会会場
20:00 ~ 22:00	ざっくばらんトーク1 全員参加	
22:00 ~	Freeざっくばらんトーク 任意参加	

## 8月23日(土)

時間	テーマ / 内容	会場
7:00 ~ 9:00	朝食	1F レストラン
9:10 ~ 9:20	2日目案内 久芳 聡子(日本電子)	
[チュートリアル] 座長: 大森 典子(コバレントマテリアル)		
9:20 ~ 10:30	SEM/EBSD 法- TEM/ASTAR 法 を用いた結晶方位マップの作成 TSLソリューションズ 鈴木 清一 様	1F 第2会議室
10:30 ~ 10:45	休憩	
[トピックス] 座長: 工藤 修一(ルネサス セミコンダクタ マニュファクチャリング)		
10:45 ~ 11:20	半導体デバイスの格子歪観察 日本電子 遠藤 徳明 様	
11:20 ~ 11:55	3次元アトムプローブを用いた材料解析例 東北大学 清水 康雄 様	
11:55 ~ 12:05	記念撮影	
12:05 ~ 13:00	昼食	1F レストラン
[一般講演] 座長: 木村 耕輔(東レリサーチセンター)		
13:00 ~ 13:20	明視野像・暗視野像を用いた高度な材料解析 青山学院大学 中村 新一 様	1F 第2会議室
13:20 ~ 13:40	カーボン膜の微細形態評価 キヤノン 元井 泰子	
13:40 ~ 14:00	電子回折パターンのリアルタイム解析ソフトの開発 日鉄住金テクノロジー 伊藤 敦広 様	
14:00 ~ 14:10	休憩	
[ざっくばらんトーク] 司会: 乾 光隆(セイコーエプソン)		
14:10 ~ 15:40	ざっくばらんトーク2、話題提供、Q & A、総合討論	
15:40 ~ 15:50	閉会の挨拶と帰りのご案内 長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)	